

半導体の変種変量生産を実現する ミニマルファブ

産総研九州センター IoTデバイス実証プロジェクト

- ▶ ミニマルファブとは、直径0.5インチのウェハを利用し、クリーンルーム、露光用マスクを必要とせず、1個からデバイス作製を可能とする半導体製造システム
- ▶ 資源消費を抑え、半導体の変種変量生産を可能にする

IoTデバイス実証プロジェクトの試作ライン

- 【特徴】
- オフィスフロア程度の小スペース設置可能
 - 高さ1440mm, 幅294mm, 奥行450mm の小型装置
 - クリーンルーム、露光用マスク不要
 - 設備投資とランニングコストの大幅削減
 - 変種変量製造が可能（開発試作短TAT化）



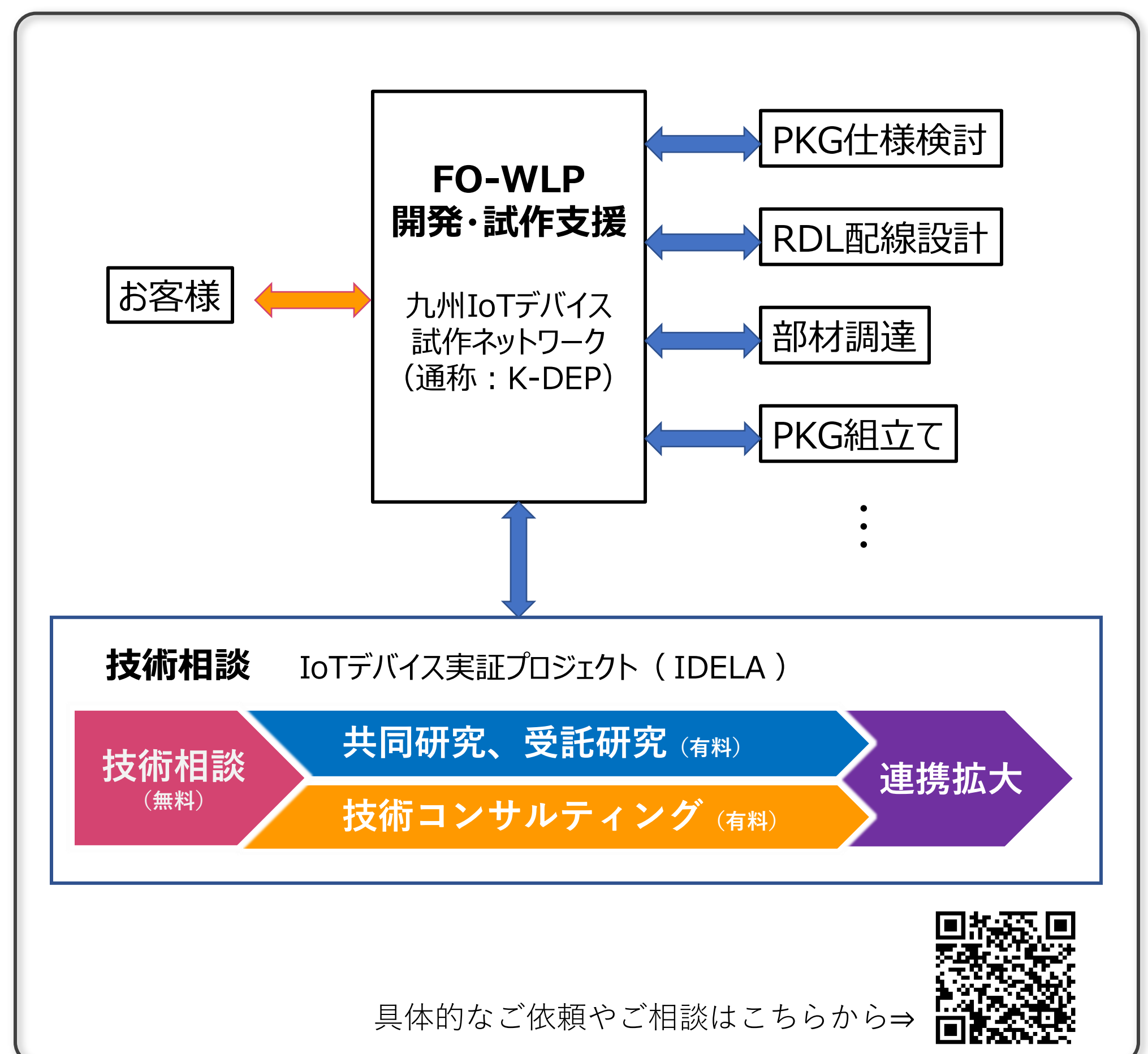
産総研九州センター
IoTデバイス実証プロジェクトの試作ライン

フォトリソプロセスを使用した再配線（RDL）形成技術を核に、RDL-FirstおよびRDL-Last工法によるファンアウトウエハーレベルパッケージ（FO-WLP）や関連するプロセス開発・試作等が可能。

多種多様なデバイス試作ニーズへの対応

RDL-First と RDL-Last 工法の組み合わせによる3次元FO-WLPの工法開発

IoTデバイス等の開発・試作に関する技術相談/コンサルティング/共同研究等の支援活動推進



具体的なご依頼やご相談はこちらから⇒

